

明志科技大學

規章編號

A180160006

材料工程系  
專業能力畢業門檻及輔導要點

制定部門：材料工程系  
中華民國110年2月4日修訂

修訂記錄：

103.06.25系務會議制訂  
103.07.14院課程委員會議審議  
103.07.15教務會議審議  
104.10.14系務會議修訂  
104.11.23院課程委員會議審議  
105.02.16教務會議審議  
105.04.19系務會議修訂  
105.06.24院課程委員會議審議  
105.07.19教務會議審議  
107.03.01系務會議修訂  
107.04.27院課程委員會議審議  
107.05.29教務會議審議  
109.02.27系務會議修訂  
109.04.16院課程委員會議審議  
109.04.21教務會議審議  
110.02.04系務會議修訂  
110.02.24院課程委員會議審議  
110.03.30教務會議審議

著作權人:明志科技大學

## 目 錄

	頁次
第一條 目的	1
第二條 對象	1
第三條 畢業門檻	1
第四條 輔導措施	1
第五條 實施與修訂	2

明志科技大學  
材料工程系專業能力畢業門檻及輔導要點

103.06.25系務會議制訂  
110.02.04系務會議修訂

第一條 目的

為配合國家科技發展政策，培育材料工程系（以下簡稱本系）學生專業能力與就業競爭優勢，以因應產業需求，訂定「材料工程系專業能力畢業門檻及輔導要點」（以下簡稱本要點）。

第二條 對象

本系101學年起入學之大學部四年制學生。

第三條 畢業門檻

取得本系精密儀器證照4張(或4張以上)始得畢業，其中證照種類、設備種類與至少通過證照數目規定如下表。

證照種類	設備種類	備註
製程設備證照	電漿聚合、液態電漿、蒸鍍設備、濺鍍設備、化學氣相沉積(CVD)、 <b>原子層沉積設備(Atomic Layer Deposition, ALD)</b>	至少獲得一張證照
檢測設備證照(A類)	原子力顯微鏡(AFM)、電子顯微鏡(SEM)、X光繞射儀(XRD)、紫外光/可見光光譜分析儀(UV-VIS)、橢圓儀(Ellipsometer)、拉曼光譜儀(Raman)	至少獲得一張證照
檢測設備證照(B類)	霍爾量測儀(Hall)、輪廓儀( $\alpha$ -Step)、四點探針(Four-Point Probe)、熱重分析儀(TGA)、熱差分析儀(DSC)、紅外光光譜儀(FTIR)、入射光子對電子的轉換效率儀(IPCE)、太陽光模擬器、 <b>白光干涉儀(White Light Interferometry, WLI)</b>	至少獲得二張證照

第四條 輔導措施

專業能力畢業門檻實施要點

107學年度起（含104至106學年度）入學之四技日間部學生：畢業前若無法取得前條所述之證照，則須修滿本系所開授材料分析與材料製程相關選修課程9門課包括「材料製程概論、薄膜製程、電漿製程、光電薄膜混成製程、奈米檢測分析、材料選擇與設計、高分子物性與化性、電子顯微鏡分析、材料破壞與分析」之中的6門課，並及格者始得畢業。

#### 第五條 實施與修訂

本要點經系務會議通過，送環境資源學院院級會議及教務會議審議後，陳校長核定後公布實施，修訂時亦同。